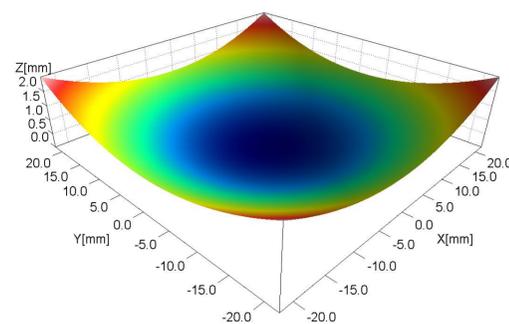


# 大径レンズや複雑形状光学面の形状測定が可能な 非接触三次元測定システム (STILオプティカルペン)

球面、半球面、非球面などの  
回転対象物から平面、自由曲面  
までを非接触にて測定。

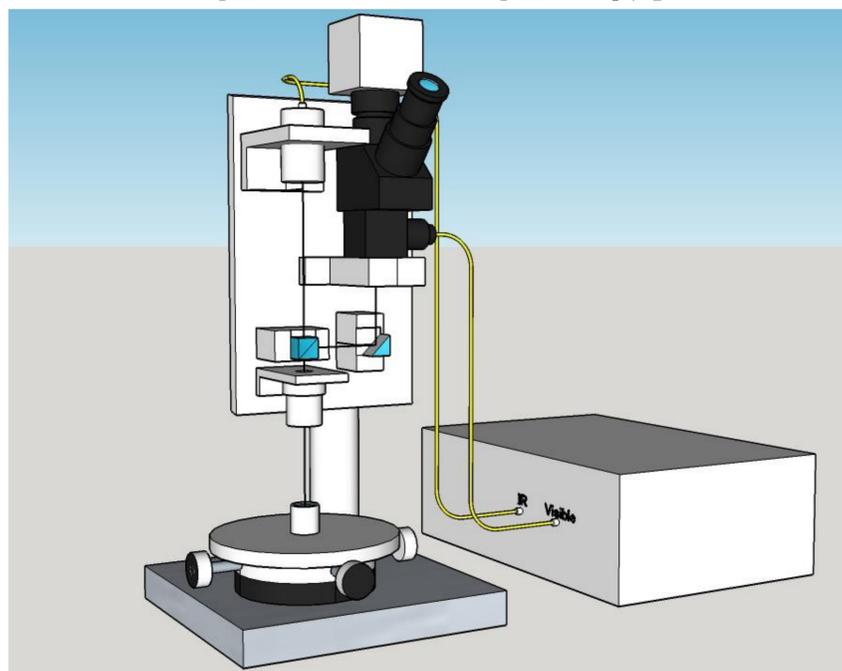
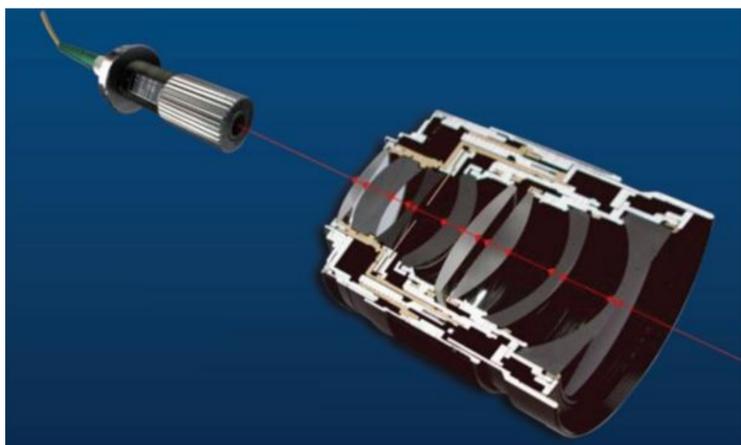


二次元XY測定  
(トーリック面の測定例)

## 非接触厚さ測定器「LENSSCAN」

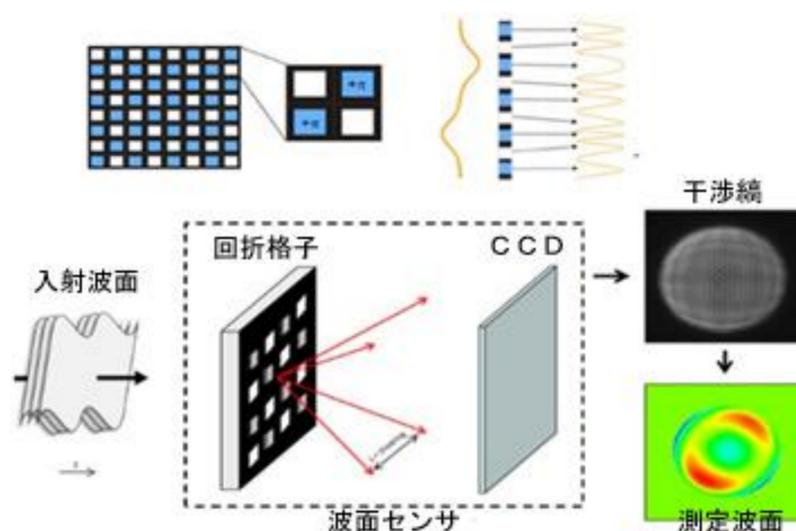
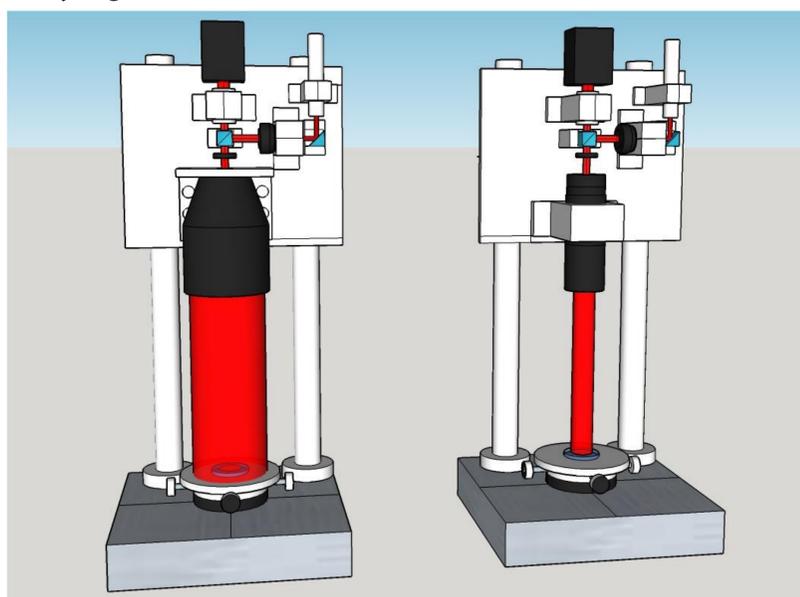
FOGALE nanotech

FOGALE社独自の低コヒーレントレーザー干渉計を用いた非接触光学厚さ測定器です。レンズ単体の厚さ、組レンズの位置情報などを観察することができます。また、偏芯測定器を組み合わせることで組レンズの組立調整にも応用できます。



## 光学波面測定器「SID4」

PHASICS社独自の2次元グリッド回折格子による改良ハルトマン法を応用した高速、高精度の波面測定器です。波長域、測定範囲を自由に選択可能です。また、この波面測定器を応用したコンパクトな干渉計システムをご提案致します。



測定原理